NINT 나노융합기술원

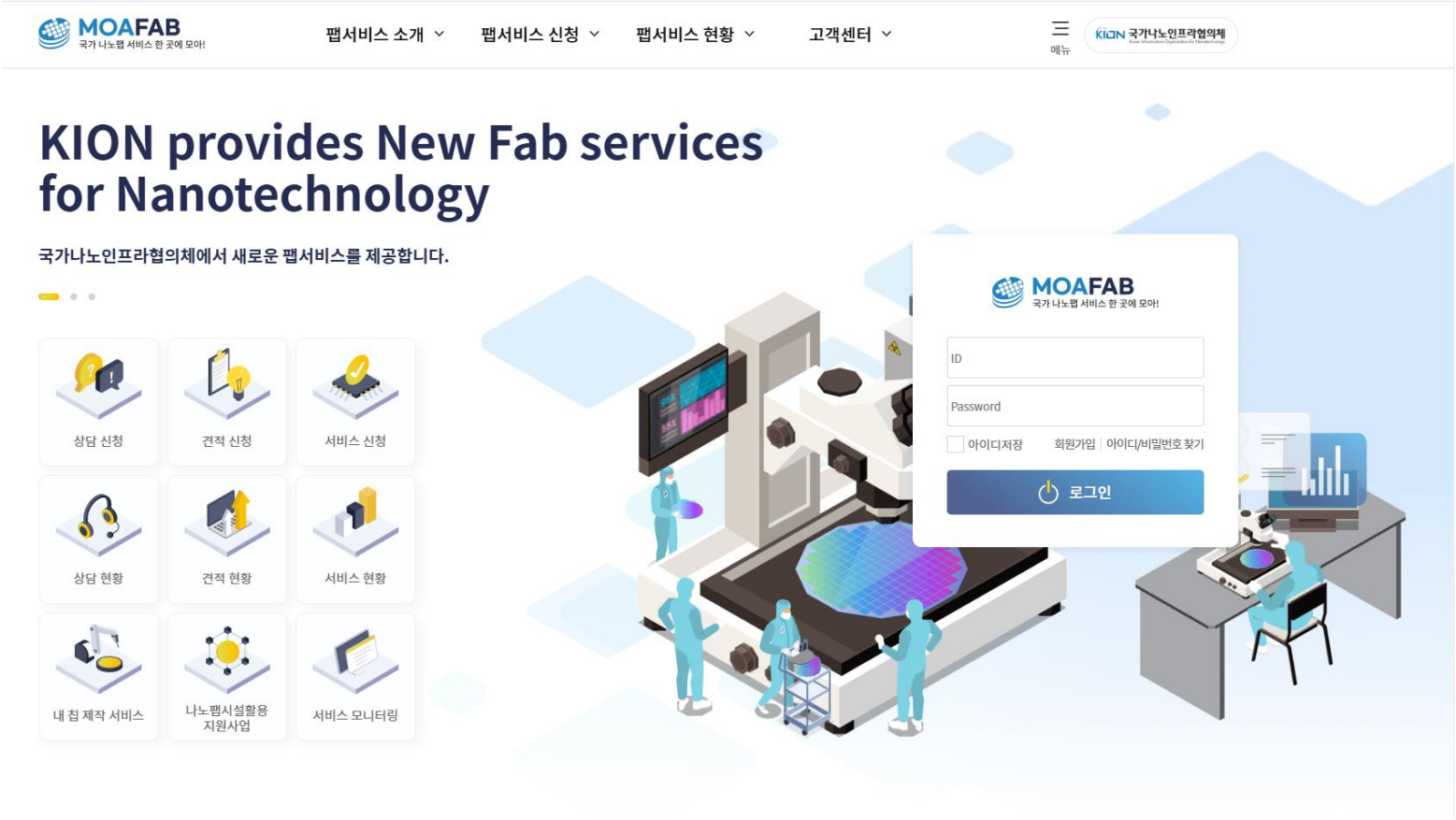
MOAFAB

분석 서비스 신청 가이드

INDEX

I. 서비스 신청 방법 (P5)
II. 장비별 신청 방법 (P14)
III. 두 시간 이상 신청 방법 (P19)
IV. 예약 승인 확인 방법 (P23)
V. 예약 취소 방법 (P26)
VI. 장비별 예약 확인 방법 (P29)
VII. 시험분석결과서 발급 방법 (P32)

회원가입 및 로그인



모아팹 홈페이지 접속 후 회원가입 및 로그인

** 기존 NINT 사용자도 모아팹 회원가입 필수

https://www.moafab.kr

NINT MOAFAB 신청 방법

** 둘 중 하나 택 1

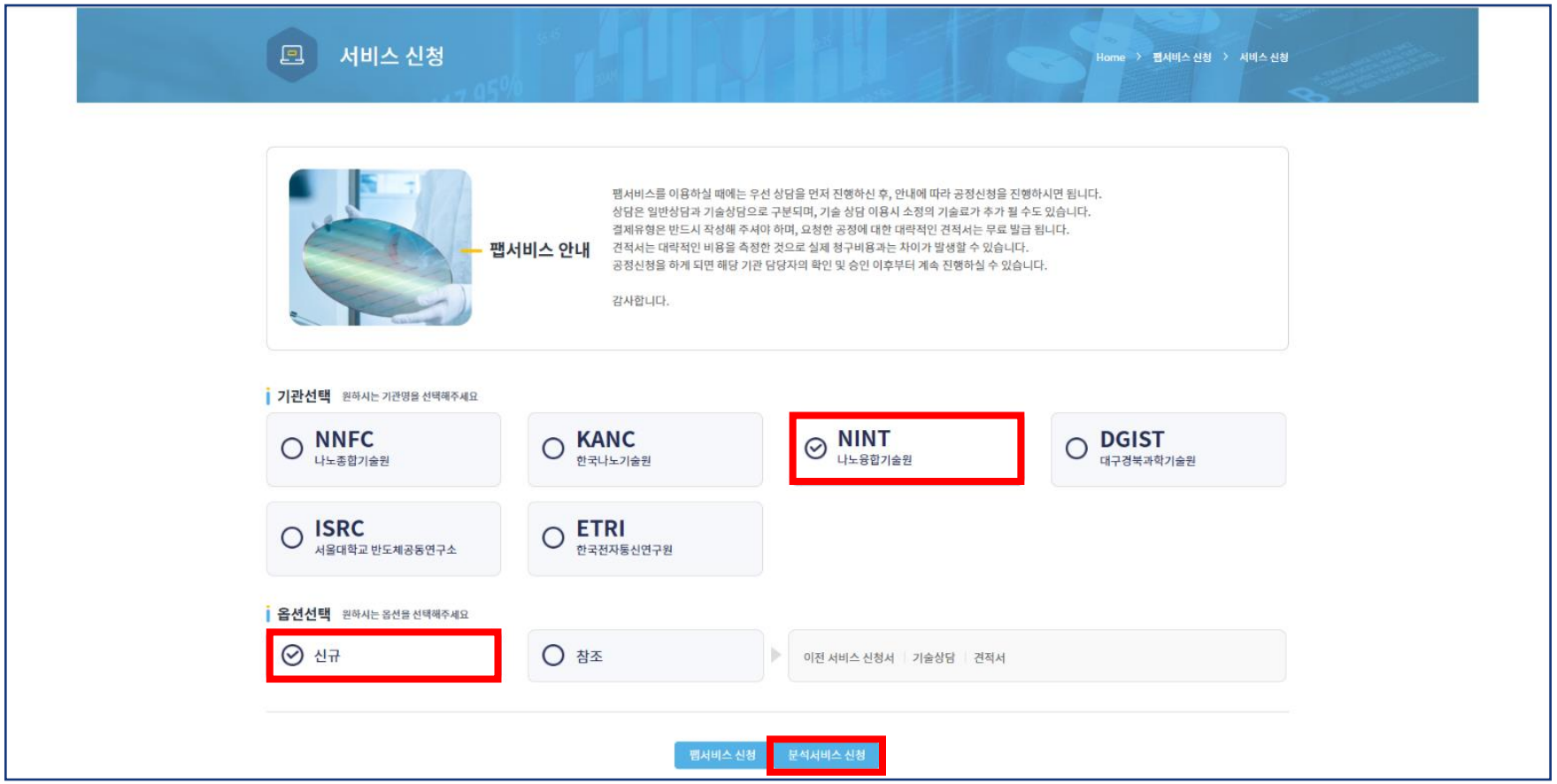
① 서비스 신청 방법 p5 ~ 13

② 장비별 신청 방법 p15 ~ 18

서비스 신청 방법

서비스 신청 방법 (1) - 기관/ 옵션/ 분석 서비스 신청 선택

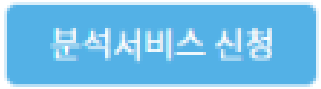
서비스 신청



① 기관선택

② 옵션선택

③ 분석 서비스 신청



** 이후 비슷한 샘플 분석 의뢰 및 직접 사용시에는 **참조 → 이전 서비스 신청서**를 선택하시면 이전 정보를 불러올 수 있습니다.

서비스 신청 방법 (2) - 신청 정보 작성

서비스 신청

① 시료 수탁 예정일 : 시료가 기관에 도착할 날짜

② 신청 방식
- 기관설계 : 공정/장비 및 순서를 모두 기관에게 의뢰
- 본인설계 : 공정/장비 및 순서를 신청자가 직접 설계

** 분석 장비를 사용을 원하시는 분들은 본인 설계로 신청해주세요.
본인 설계로 진행 해야지 장비 선택이 가능합니다.

③ 진행 방법
- 장비 의뢰진행 : 장비 담당자가 공정 진행
- 장비 직접사용 : 사용자가 직접 공정 진행

+) 장비 라이선스 교육을 원하는 경우
: 신청분야와 이용목적을 교육, 장비교육으로 선택

서비스 신청 방법 (3) - 분석 시료 정보/ 결제 및 수령 방법 작성

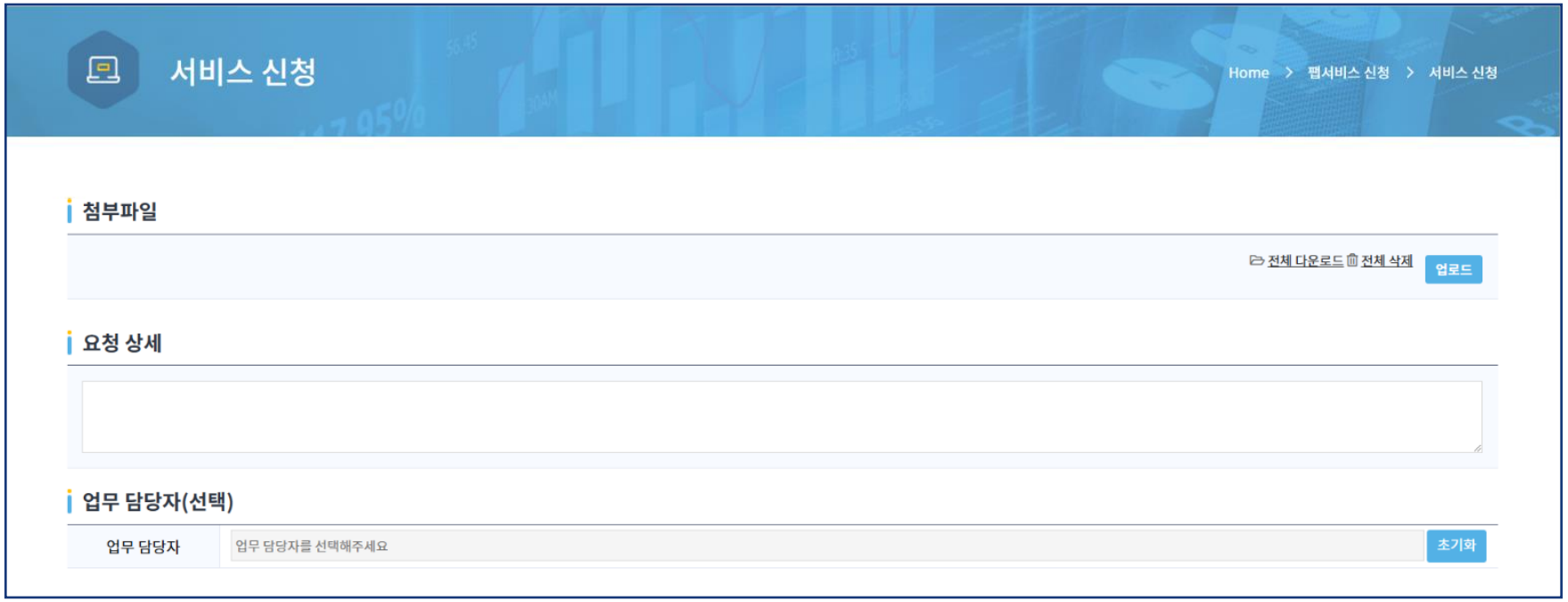
서비스 신청

** 결제 및 수령 방법 작성 시 유의 사항

① 결제 유형 : 각 기관의 정산 담당자가 있는 경우 자동으로 생성
② 연구 책임자 : 포스텍 소속일 경우, 필수 선택

서비스 신청 방법 (4) - 첨부파일/ 요청 상세/ 업무 담당자 작성 및 선택

서비스 신청



① 첨부파일 : 첨부파일이 있는 경우 업로드

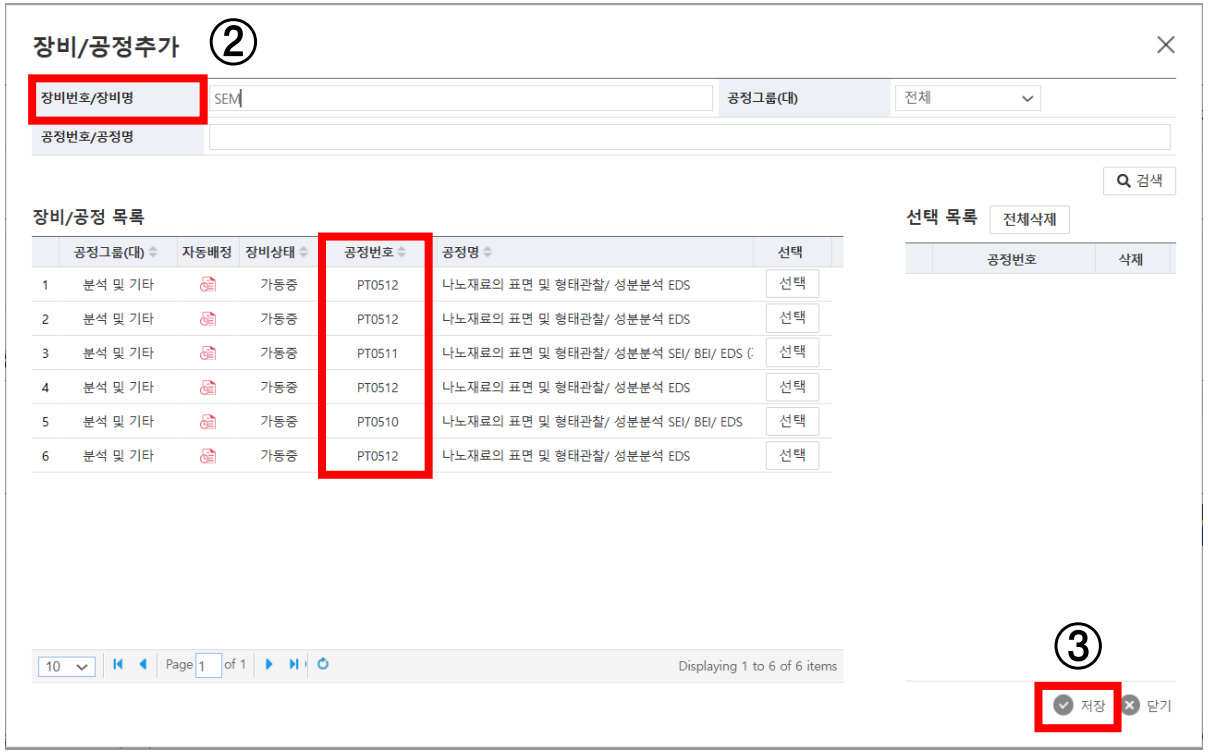
② 요청 상세 : 추가 요청 내용이 있는 경우 작성

③ 특정 업무 담당자에게 요청할 경우 선택

- 예약할 장비 담당자 선택해주시면 됩니다.

서비스 신청 방법 (5) - 공정 절차 : 장비 선택

서비스 신청



① 장비/ 공정 추가 버튼 선택

- 신청방식이 **[본인설계]인 경우에만 이 버튼이 활성화** 됩니다.
- 꼭 본인 설계로 진행해주세요. (P6 참고)

② 원하는 장비를 [장비번호/장비명]에 검색 후 선택

- **장비 별로 겹치는 공정 번호가 있으니 확인 후 예약** 부탁드립니다.
- 공정 번호는 P10 참고해주세요.

③ 저장 선택

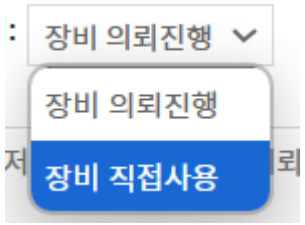
서비스 신청 방법 (5) - 장비 별 공정 코드

No.	장비 명	공정번호	담당자	공정 명
1	3D Conforcal Scanning Microscope (3DCSM)	PT0502	김정훈	비접촉 3D 형상측정
2	Atomic Force Microscope- II (Jupiter XR) / AFM- II	PT0756	한은영	특수모드 (PFM, KPFM, C-AFM, AMFM 등)
3	Atomic Force Microscope- II (Jupiter XR) / AFM- II	PT0755	한은영	미세탐침을 이용한 표면 형상 분석
4	Focused Ion Beam - I (Helios 600 with TKD) / FIB - I	PT0505	백경흠	3차원 가공 및 TEM 시료제작, 단면 관찰, 미세 집합조직 해석
5	Focused Ion Beam - II (Helios 650 with EBSD) / FIB - II	PT0754	이단비	3차원 가공 및 구조의 입체적 분석, 미세 집합조직 해석
6	Focused Ion Beam - III (Helios G3 CX) / FIB- III	PT0508	김성규	나노 정밀도 이온빔을 이용한 3차원 마이크로 단위 시료 제작 및 가공
7	Focused Ion Beam -IV (SMI 3050) / FIB-IV	PT0509	김정훈	3차원 가공 및 TEM 시료제작, 단면 관찰
8	High Resolution FE-SEM-I (JSM 7401F)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
9	High Resolution FE-SEM- II (JSM 7800F PRIME with Dual EDS)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
10	High Resolution FE-SEM- II (JSM 7800F PRIME with Dual EDS)	PT0511	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정 시 담당자와 사전협의 후 진행)
11	High Resolution FE-SEM- III (HITACHI S-4800)	PT0512	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
12	High Resolution FE-SEM- III (HITACHI S-4800)	PT0510	신혜연	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS
13	High Resolution FE-SEM-IV (JSM-IT710HR)	PT0512	한은영	나노 재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS
14	High Resolution Powder-XRD	PT0760	최혜원	분말 회절 분석 : 정성, 정량, 결정화도, 격자상수, 결정자 사이즈 / 격자변형평가 등 - 결정성 분말, 시료의 정성분석 및 결정구조 분석
15	HR-[S]TEM- I (2100F with Probe Cs-Corrector)	PT0514	김정훈	투과 전자 빔에 의한 나노 구조/성분분석 TEM/ STEM/ EDS/ BF/ HAADF
16	HR-[S]TEM - II (2200FS with Image Cs-corrector)	PT0513	박현진	나노구조/성분 분석(TEM/BF/DF/SAED/EF-TEM(EELS Mapping)/STEM/BF/HAADF/EDS)
17	Raman Spectroscopy	PT0817	한은영	Raman Spectroscopy (Spectrum/Mapping)
18	UV/Vis/nIR Spectrometer	PT0528	한은영	UV/Vis/nIR 측정

- **노란색으로 표시되어 있는 장비(SEM-1, 2, 3, 4)는 공정 번호 동일**
- **장비 사용 시 공정 번호가 아닌 장비명을 검색**
  예) SEM-1 장비 예약 시, [7401] 검색

서비스 신청 방법 (6) - 공정 절차 : 진행방법/ 예약 시간 선택

서비스 신청



① 진행 방법] 장비 의뢰 진행 / 장비 직접 사용 선택

- 직접 사용 유저분이 장비 의뢰 진행으로 선택 시, 서비스 비용으로 청구 됩니다.
- 꼭 알맞은 진행 방법을 선택해주세요!

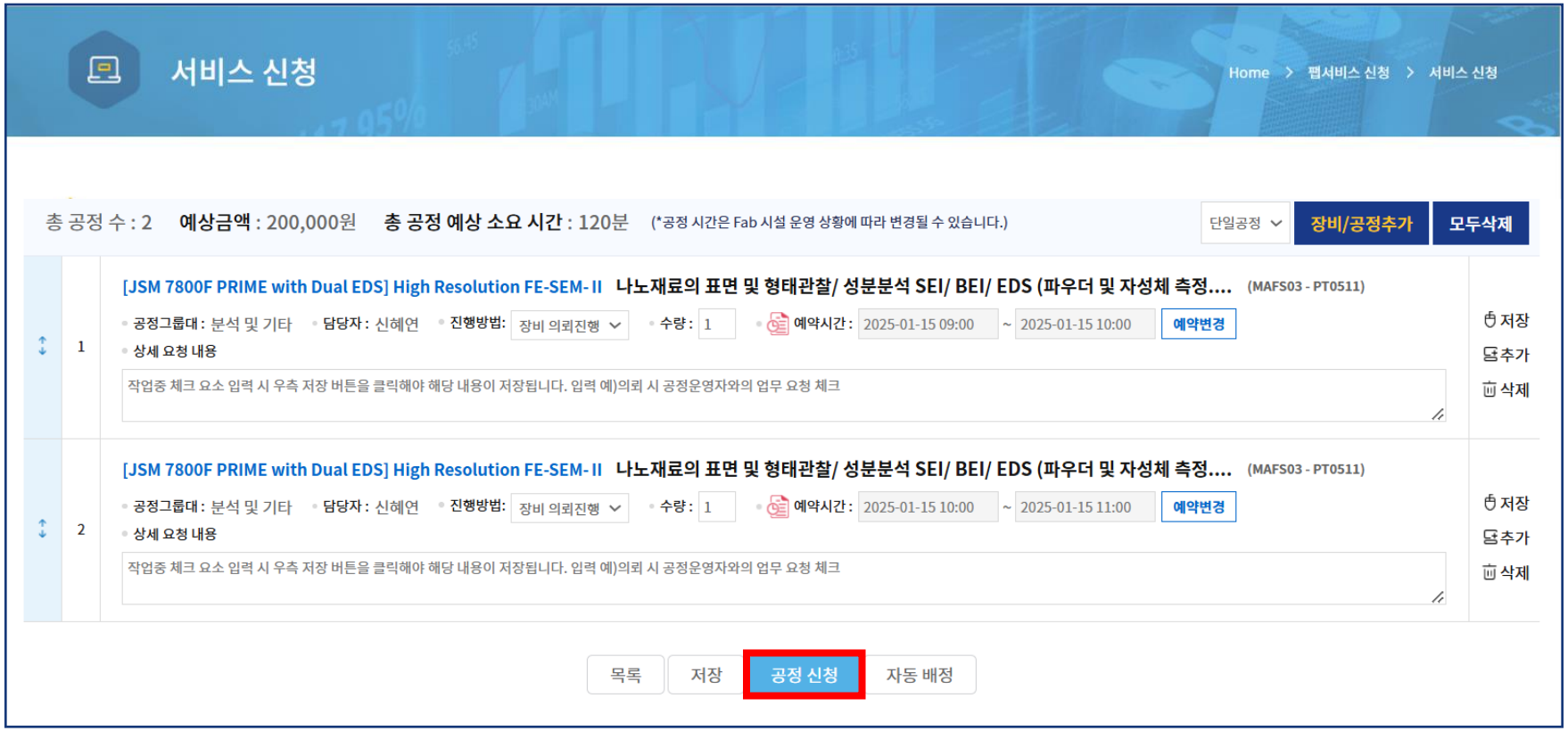
② 예약 변경

- **2시간 이상 예약을 하고 싶으신 분은 P19를 참고해주세요.**

- **공휴일 및 주말 예약이 안됩니다. (평일 야간 예약은 가능)**
- 공휴일 및 주말에 예약을 원하시는 분은 장비 담당자에게 문의해주시면 예약 도와드리겠습니다.

서비스 신청 방법 (7) - 공정 신청 완료

서비스 신청

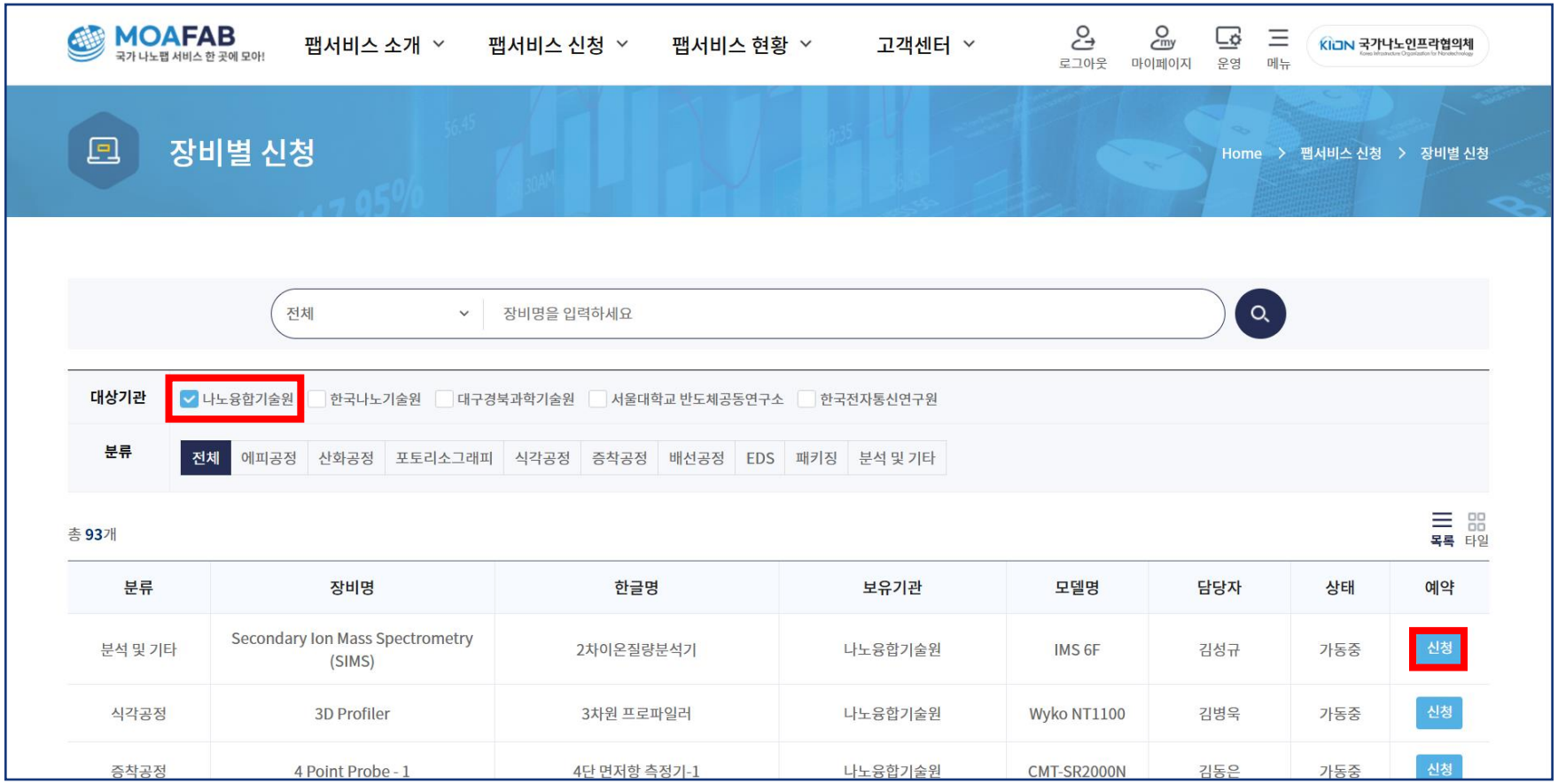


[공정 신청] 버튼을 눌러 예약 완료

장비별 신청 방법

장비별 신청 방법 (1) - 장비 선택

장비별 신청

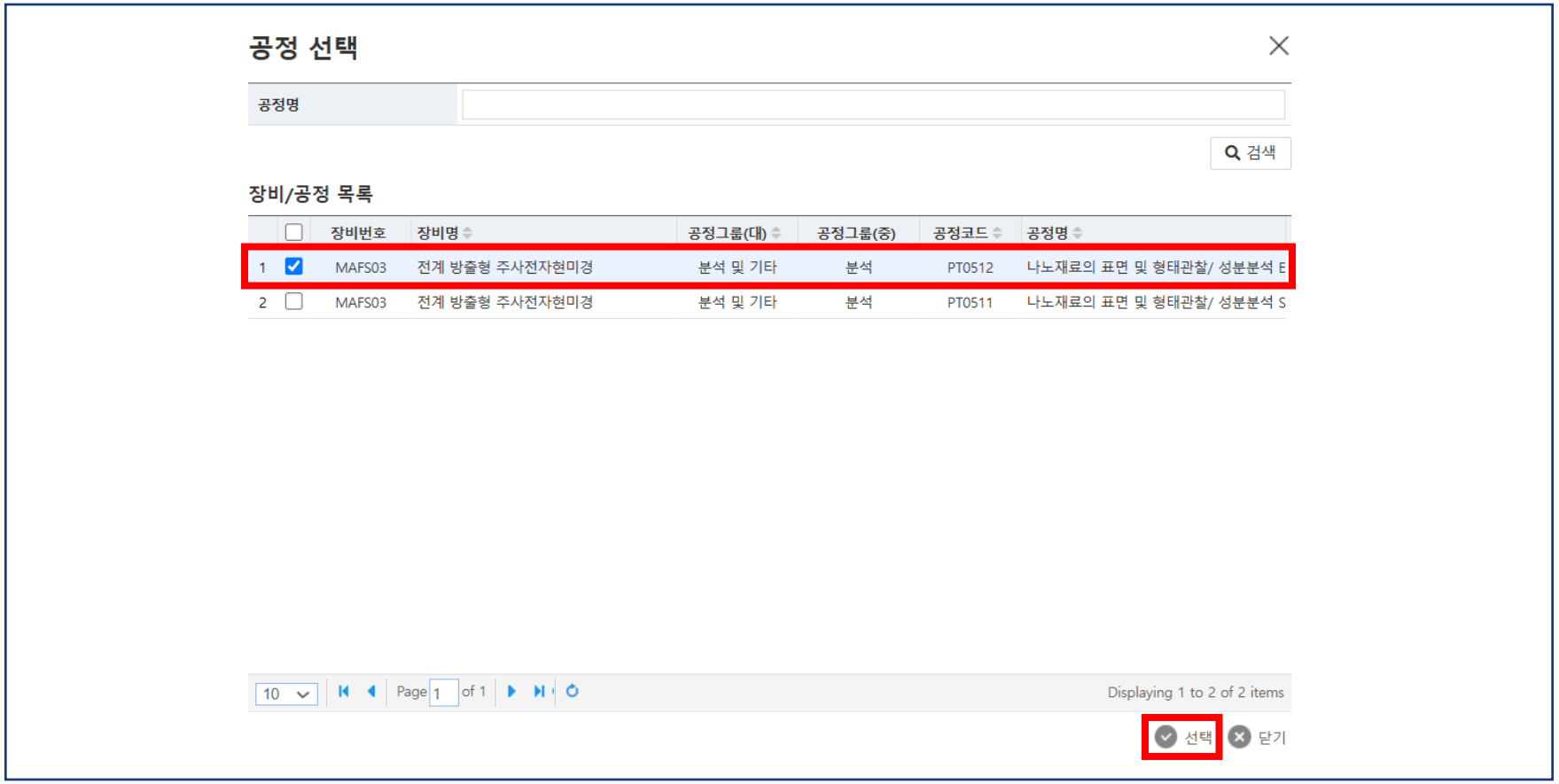


① 나노융합기술원 선택

② 원하는 장비 선택

장비별 신청 방법 (1) - 장비 선택

장비별 신청

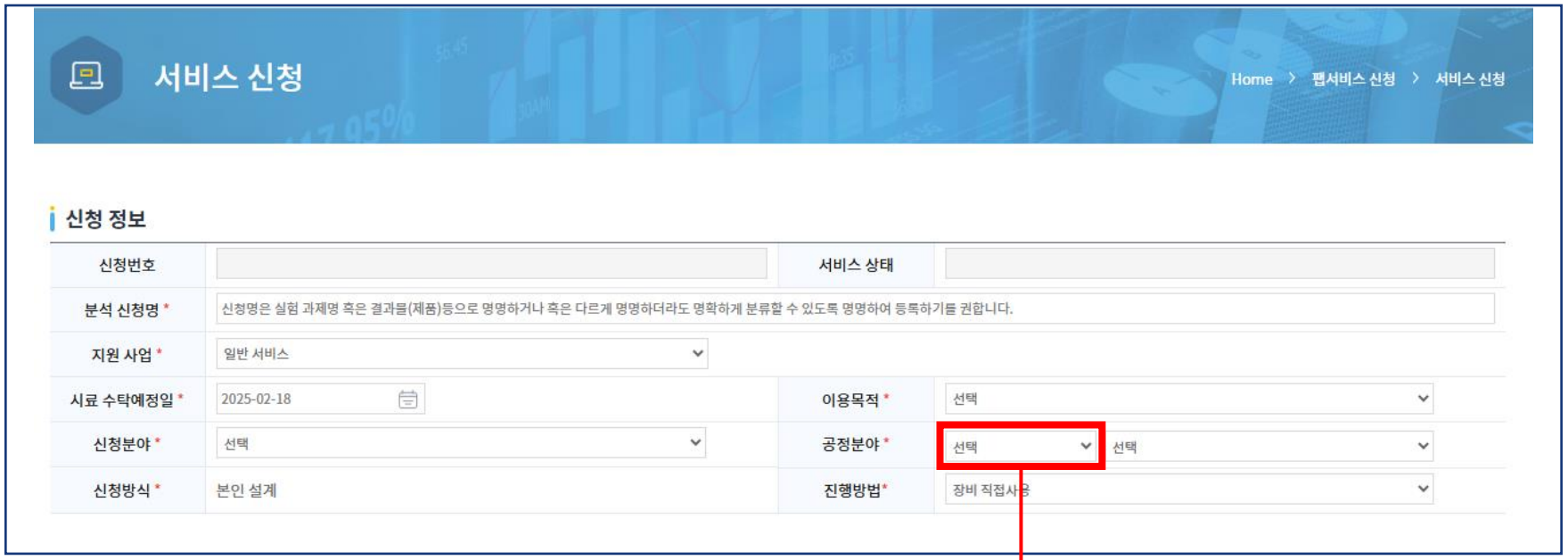


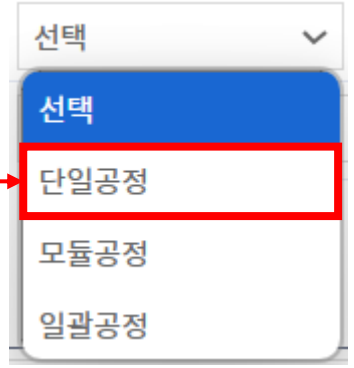
③ **원하는 분석 선택**

- 공정명이 잘려서 보인다면, P10 장비별 코드 참고바랍니다.

장비별 신청 방법 (2) - 신청정보 작성

장비별 신청





① 공정분야

- [단일 공정] 선택해주세요.

② 신청 방식

- **기관설계 : 공정/장비 및 순서를 모두 기관에게 의뢰**
- **본인설계 : 공정/장비 및 순서를 신청자가 직접 설계**

** 분석 장비를 사용을 원하시는 분들은 본인 설계로 신청해주세요.
본인 설계로 진행 해야지 장비 선택이 가능합니다.

장비별 신청 방법 (3) - 공정 절차 확인

③ 공정 절차

- 서비스 신청 방법과 다르게 공정 절차 부분에 예약 시간 및 직접 사용/ 서비스 선택하는 버튼이 활성화되어 있지 않습니다.
- 이 부분도 아래쪽 [저장] 버튼을 눌러 주시면 활성화 됩니다.

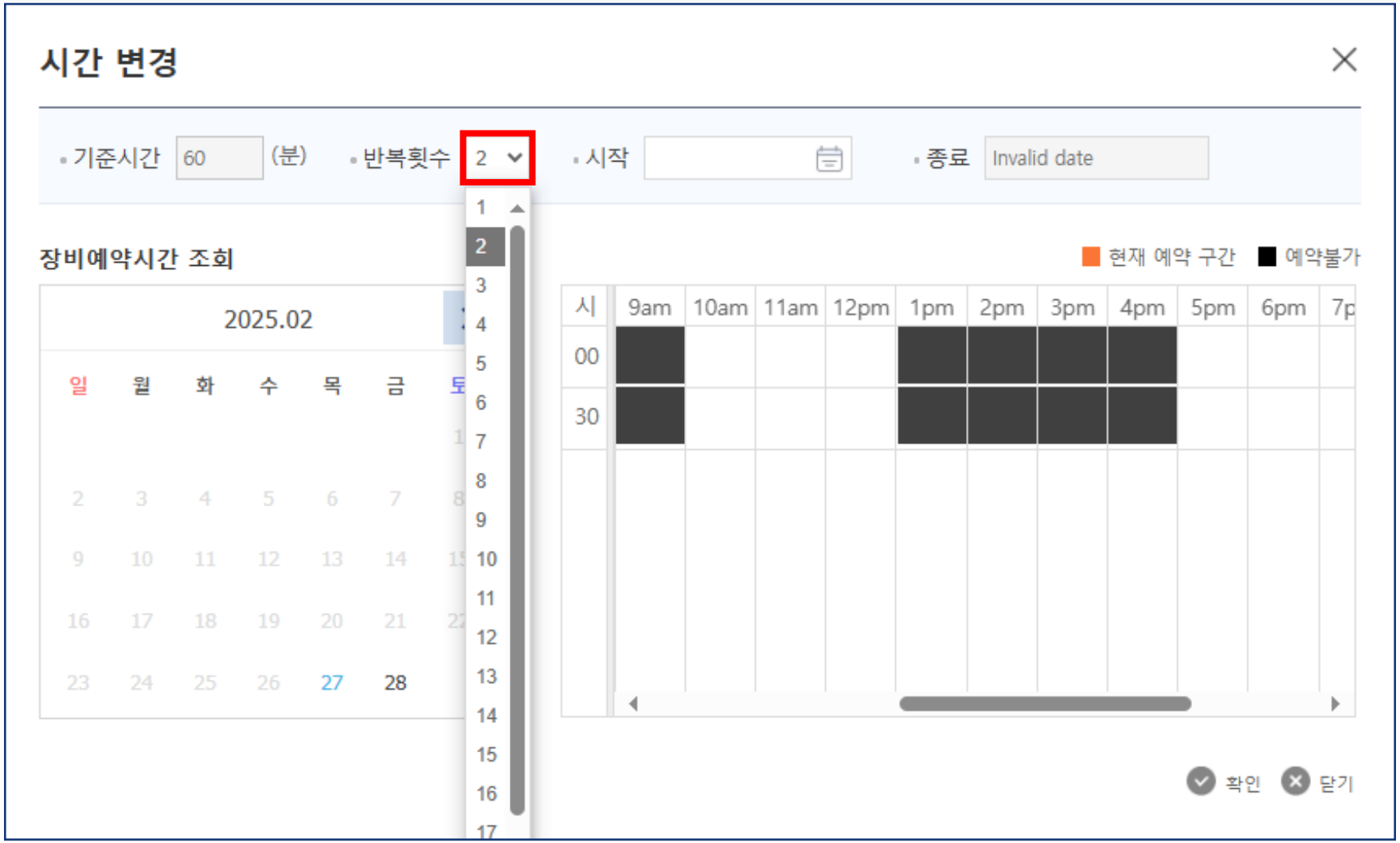
이후, 서비스 신청 방법과 동일하게 작성해주시면 됩니다.

두 시간 이상 예약 방법

두 시간 이상 예약 방법 (1) - 예약 변경 선택

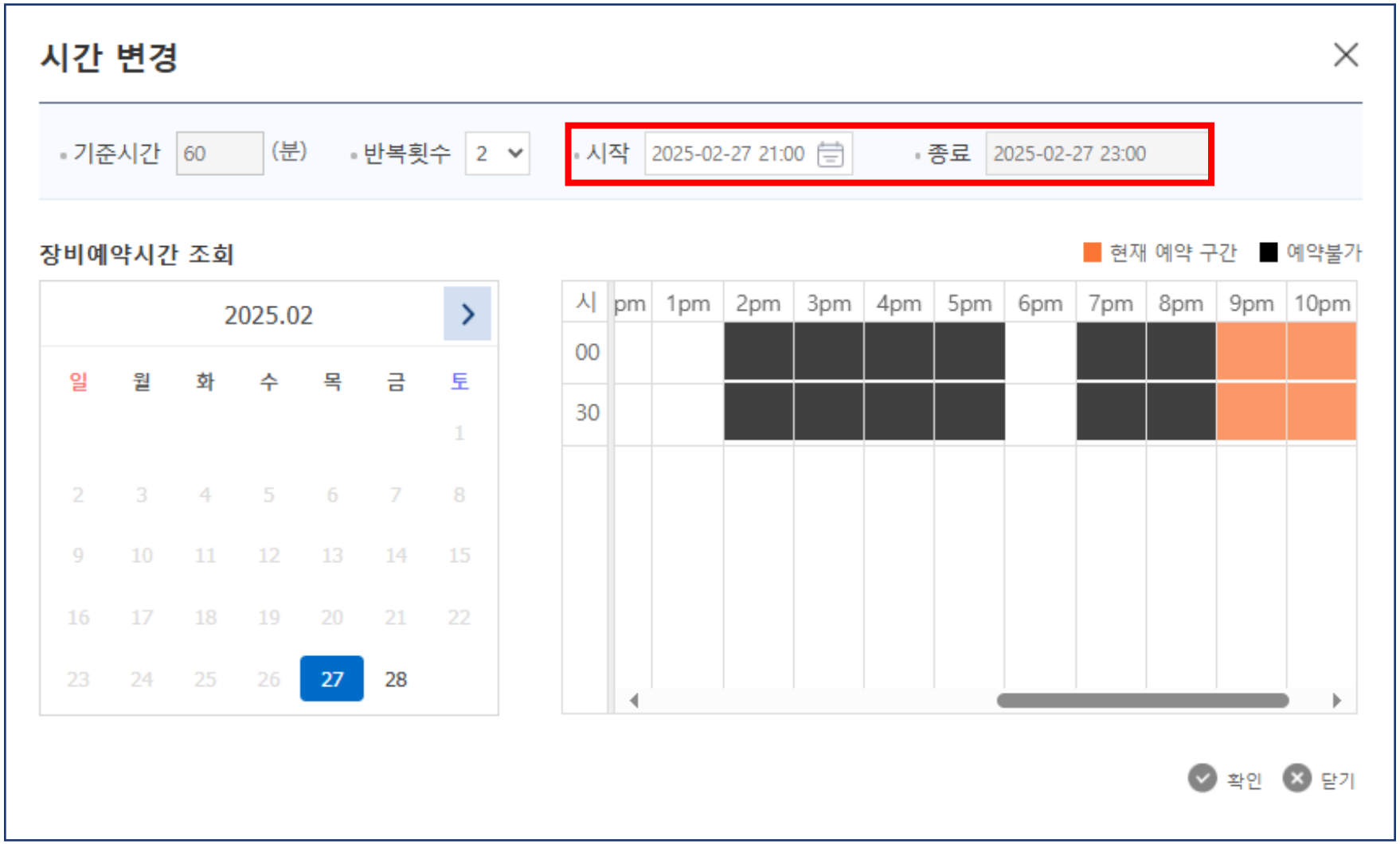
예약 변경 선택

두 시간 이상 예약 방법 (2) - 반복 횟수 선택



- **반복 횟수 선택**
- [반복 회수 = 분석 시간] 입니다.
- 두 시간을 원하신다면 반복 회수 2를 선택해주시면 됩니다.

두 시간 이상 예약 방법 (3) - 시작 시간 설정



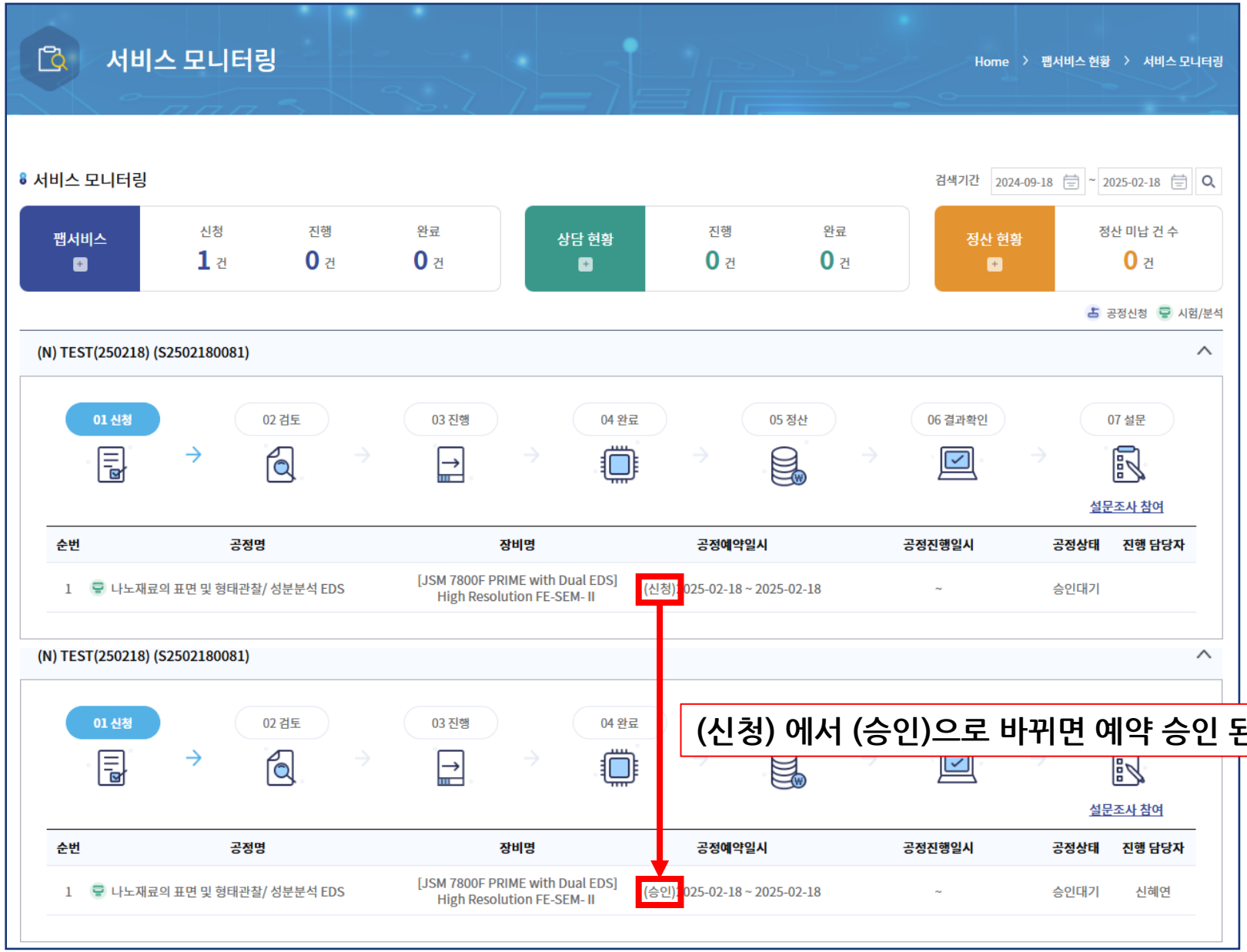
- 시작 시간을 설정해주시면, 종료 시간도 함께 설정됩니다.

예약 승인 확인 방법

예약 승인 확인 방법 (1) - 서비스 모니터링

서비스 모니터링 선택

예약 승인 확인 방법 (2)



(신청) 에서 (승인)으로 바뀌면 예약 승인 된 것입니다.

예약 취소 방법

예약 취소 방법 (1) - 서비스 현황

서비스 현황 선택

예약 취소 방법 (2)

1. **취소 및 삭제 버튼이 활성화 O** : 해당 버튼을 눌러 주시면 취소 됩니다.
2. **취소 및 삭제 버튼이 활성화 X** : 장비 담당자에게 문의 주세요.
3. **취소 확인 방법** : 서비스 상태가 [요청 반려]가 되었다면, 취소된 것입니다.

장비별 예약 확인 방법

장비별 예약 확인 방법 (1) - 장비별 신청에서 장비 선택

① 장비별 신청 선택

② 원하는 장비의 장비명 선택

장비별 예약 확인 방법 (2)

[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM- II

소유 기관	나노융합기술원
장비명(K)	전계 방출형 주사전자현미경
장비 코드	MAFS03
모델명	JSM-7800F Prime
제작사	JEOL Ltd.
담당자	신혜연 054-279-0286

총 2개

공정코드	공정명	장비코드	장비명	예약
PT0512	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 EDS	MAFS03	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II	신청
PT0511	나노재료의 표면 및 형태관찰/ 성분분석 SEI/ BEI/ EDS (파우더 및 자성체 측정시 담당자와 사전협의 후 진행)	MAFS03	[JSM 7800F PRIME with Dual EDS] High Resolution FE-SEM-II	신청

WAFER 사용 용도

●가능 ▲협의필요 ✕불가능

재질	Si	SOI	Glass	화합물	Quartz	기타
	✕	✕	✕	✕	✕	✕

사이즈	2"	3"	4"	5"	6"	8"	12"	기타
	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

두께	Normal	Special	상태	Notch	Flat
	✕	✕		✕	✕

장비사양 | 공정성능 | 활용분야

장비예약시간 조회

■ 예약중

2025.02

일	월	화	수	목	금	토
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

시	9am	10am	11am	12pm	1pm	2pm	3pm	4pm	5pm	6pm
00	■	■	■			■	■	■		
30	■	■	■			■	■	■		

목록

장비 예약 시간 조회 가능

시험분석결과서 발급 방법

시험분석결과서 발급 방법 (1) - 정산 현황 선택

정산 현황 선택 후 증명서 발급

이 외 궁금한 점이 있다면,
장비 담당자에게 연락 바랍니다.